

Bijlage bij accreditieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: **K 086**

van **Mitutoyo Nederland B.V.**
Service Department, Calibration Service and Technical Department

Deze bijlage is geldig van: **15-11-2023** tot **01-10-2026**

Vervangt bijlage d.d.: **05-10-2022**

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

Storkstraat 30
3905 KX
Veenendaal
Nederland

Locatie	Afkorting
Mitutoyo Nederland B.V. Storkstraat 30 3905 KX, Veenendaal Nederland	VE
On site	OS

HCS code	Meetgrootheid, Instrument, Maat	Meetbereik	CMC ¹	Opmerkingen	Locatie
DM 0 0	GEOMETRISCHE GROOTHEDEN				VE, OS
DM 1 0	Eindmaten				VE
	Lange rechthoekige eindmaten				
	- staal en keramisch - zero-glas	(100 – 1510) mm (100 – 1510) mm	0,10 µm + 0,34·10 ⁻⁶ ./ 0,10 µm + 0,20·10 ⁻⁶ ./	laserinterferometer + CMM	
	- variatie in lengte	(100 – 1510) mm	0,22 µm	laserinterferometer + CMM	
	Lange vierkante eindmaten				

¹ Calibration and Measurement Capability (CMC): Aangevoerde meetonzekerheid, met dekkingswaarschijnlijkheid van 95%, in een gegeven meetpunt of meetgebied. De meetonzekerheid, *U*, wordt berekend overeenkomstig EA-4/02 "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration".

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de
Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

van **Mitutoyo Nederland B.V.**
Service Department, Calibration Service and Technical Department

Deze bijlage is geldig van: **15-11-2023 tot 01-10-2026**

Vervangt bijlage d.d.: **05-10-2022**

HCS code	Meetgrootheid, Instrument, Maat	Meetbereik	CMC ¹	Opmerkingen	Locatie
	- staal - hardmetaal (wolframcarbide)	(100 – 500) mm (100 – 500) mm	0,10 µm + 0,34·10 ⁻⁶ ·l 0,10 µm + 0,40·10 ⁻⁶ ·l	laserinterferometer + CMM	
	- variatie in lengte	(100 – 500) mm	0,14 µm	laserinterferometer + CMM	
	Instelmaten voor buitenschroefmaten				
	- lengte	tot 1510 mm	0,10 µm + 0,50·10 ⁻⁶ ·l	laserinterferometer + CMM	
	- variatie in lengte	tot 1510 mm	0,04 µm	laserinterferometer + CMM	
	Stappeneindmaten			l _s = meetpositie (m) l _t = totale lengte (m)	
	- lengte	tot 1510 mm	0,12 µm + 0,34·10 ⁻⁶ ·l _s + 0,12·10 ⁻⁶ ·l _t	laserinterferometer + CMM	
	- variatie in lengte	tot 1510 mm	0,06 µm	laserinterferometer + CMM	
DM 2 0	Linialen, verplaatsing				VE, OS
	Verplaatsingsafwijkingen			r = rotatie, t = rechtheidsafwijking l = verplaatsing (m)	OS
	- lineaire verplaatsingen	tot 20 m tot 20 m	0,20 µm + 0,7·10 ⁻⁶ ·l 0,20 µm + 2,3·10 ⁻⁶ ·l	laserinterferometer laserinterferometer, met thermisch compensatie object	
	- rechtheidsafwijking	tot 1,5 mm tot 1,5 mm	0,8 µm + 0,8·10 ⁻³ ·t + 0,4·10 ⁻⁶ ·l 2,5 µm + 8,0·10 ⁻³ ·t + 0,4·10 ⁻⁶ ·l	laser met rechtheidsoptiek l ≤ 3 m l ≤ 20 m	
	- rotatieafwijking om de horizontale as (stampen, rollen)	-100" tot 100" -100" tot 100"	0,2" + 2,0·10 ⁻² ·r + 3,5·10 ⁻² ·(l/m)" 1,5" + 2,0·10 ⁻² ·r	laser met rotatieoptiek, l ≤ 20 m elektronische waterpassen	
	- rotatieafwijking om de verticale as (gieren)	-100" tot 100"	0,2" + 2,0·10 ⁻² ·r + 3,5·10 ⁻² ·(l/m)"	laser met rotatieoptiek, l ≤ 20 m	
	Afwijkingen bij gecombineerde verplaatsingen				OS
	- haaksheid	-300" tot 300"	1,2" (≈ 6 µm/m)	laser met haaksheidsoptiek, met lengte per as ≤ 20 m	

van **Mitutoyo Nederland B.V.**
Service Department, Calibration Service and Technical Department

Deze bijlage is geldig van: **15-11-2023 tot 01-10-2026**

Vervangt bijlage d.d.: **05-10-2022**

HCS code	Meetgrootheid, Instrument, Maat	Meetbereik	CMC ¹	Opmerkingen	Locatie
	Referentie liniaal				VE
	- zero-glas - glas	tot 650 mm	0,08 μm + 0,50 $\cdot 10^{-6}$. / 0,08 μm + 1,0 $\cdot 10^{-6}$. /	laserinterferometer + beeldverwerkingsmeetmachine	
	Linialen				VE
	- glas	tot 650 mm	0,40 μm + 1,0 $\cdot 10^{-6}$. /	laserinterferometer + beeldverwerkingsmeetmachine	
	Vergrotings- referentie (kalibratieplaat)				VE
	- glas	tot 10 mm	0,24 μm	laserinterferometer + beeldverwerkingsmeetmachine	
	Motic vergrotingsreferentie	(0 – 1,5) mm	10 μm	beeldverwerkingsmeetmachine	VE
	Afstandsreferentie	(0 - 400) mm	0,24 μm + 2,0 $\cdot 10^{-6}$. /	laserinterferometer + beeldverwerkingsmeetmachine	VE
	2-D Grids (zero-glas)				VE
	- afstand tussen 2 punten	tot 200 x 200 mm	0,8 μm + 0,5 $\cdot 10^{-6}$. /	laserinterferometer + beeldverwerkingsmeetmachine	
	- lineariteit		0,2 μm + 0,5 $\cdot 10^{-6}$. /		
	- rechtheid		0,2 μm		
	- haaksheid		0,2"		
	- rotatie		0,4"		
DM 3 0	Lengtemeet- instrumenten			<i>l</i> = gemeten lengte (m) <i>d</i> = gemeten diameter (m)	OS
	Meetklokkentesters				
	- i-Checker	(0 – 100) mm	0,10 μm + 2,2 $\cdot 10^{-6}$. / 0,06 μm + 0,8 $\cdot 10^{-6}$. /	digitaal (eindmaten) digitaal (laserinterferometer)	
	- tester 521-105	(0 – 5) mm	0,3 μm 0,9 μm	analoog (eindmaten) analoog (laserinterferometer)	

van **Mitutoyo Nederland B.V.**
Service Department, Calibration Service and Technical Department

Deze bijlage is geldig van: **15-11-2023** tot **01-10-2026**

Vervangt bijlage d.d.: **05-10-2022**

HCS code	Meetgrootheid, Instrument, Maat	Meetbereik	CMC ¹	Opmerkingen	Locatie
	- tester 521-103	(0 – 1) mm	0,3 µm 4,5 µm	analoog (eindmaten) analoog (laserinterferometer)	
	Lage meetkracht hoogtemeters				
	- VL-50 / -50A/ Elecont	(0 – 50) mm	0,06 µm + 2,2·10 ⁻⁶ ./	Prestatietest met eindmaten	
	- VL-50S/-50AS	(0 – 50) mm	0,64 µm + 0,40·10 ⁻⁶ ./		
	Hoogtemeters				
	- lineaire verplaatsing	(0 – 1000) mm	0,8 µm + 3,8·10 ⁻⁶ ./ 0,2 µm + 2,3·10 ⁻⁶ ./	stalen stappeneindmaat stalen stappeneindmaat of laserinterferometer en beiden met thermische compensatie object. Zie DM 2 0 In combinatie met kalibratie van granieten vlakplaat.	
	- haaksheid		7,0 µm	hoekhaak	
	- rechtheid		1,6 µm	lange been hoekhaak	
	Profielprojectoren	<u>PJ / PV / PH-type</u> (0 – 50) mm (0 – 300) mm Vergrotingsfout	1,5 µm + 2,4·10 ⁻⁶ ./ 1,4 µm + 6,6·10 ⁻⁶ ./ 0,02%		
	Meetmicroscopen	<u>TM-type</u> (0 – 50) mm <u>MF-type</u> (0 – 50) mm (0 – 300) mm	2,0 µm + 3,2·10 ⁻⁶ ./ 0,9 µm + 3,6·10 ⁻⁶ ./ 0,9 µm + 7,9·10 ⁻⁶ ./		
	Beeldverwerkings meetmachines (Optische Meetsystemen)				
	3-D (<u>QV-type</u>): glas Met automatische thermische compensatie	(0 – 200) mm (0 – 400) mm (0 – 1000) mm	0,2 µm + 0,8·10 ⁻⁶ ./ 0,2 µm + 1,2·10 ⁻⁶ ./ 0,2 µm + 1,3·10 ⁻⁶ ./	X- en Y-as, 2D en 3D X- en Y-as, 2D en 3D X- en Y-as, 2D en 3D	
		(0 – 100) mm (0 – 250) mm	0,5 µm + 1,0·10 ⁻⁶ ./ 0,5 µm + 1,6·10 ⁻⁶ ./	Z-as Z-as	

van **Mitutoyo Nederland B.V.**

Service Department, Calibration Service and Technical Department

Deze bijlage is geldig van: **15-11-2023 tot 01-10-2026**

Vervangt bijlage d.d.: **05-10-2022**

HCS code	Meetgrootheid, Instrument, Maat	Meetbereik	CMC ¹	Opmerkingen	Locatie
	3- D (QV-type): glas Met handmatige thermische compensatie	(0 – 200) mm (0 – 400) mm (0 – 1000) mm	0,2 µm + 2,0·10 ⁻⁶ ./ 0,2 µm + 2,5·10 ⁻⁶ ./ 0,2 µm + 2,7·10 ⁻⁶ ./	X- en Y-as, 2D en 3D X- en Y-as, 2D en 3D X- en Y-as, 2D en 3D	
		(0 – 100) mm (0 – 250) mm	0,5 µm + 1,8·10 ⁻⁶ ./ 0,5 µm + 2,5·10 ⁻⁶ ./	Z-as Z-as	
	3- D (QV-type): glas Zonder thermische compensatie	(0 – 200) mm (0 – 400) mm (0 – 1000) mm	0,2 µm + 2,5·10 ⁻⁶ ./ 0,2 µm + 2,9·10 ⁻⁶ ./ 0,2 µm + 3,2·10 ⁻⁶ ./	X- en Y-as, 2D en 3D X- en Y-as, 2D en 3D X- en Y-as, 2D en 3D	
		(0 – 100) mm (0 – 250) mm	0,5 µm + 2,4·10 ⁻⁶ ./ 0,5 µm + 3,3·10 ⁻⁶ ./	Z-as Z-as	
	3- D (QV-type): zero-glas Met automatische thermische compensatie	(0 – 400) mm (0 – 1000) mm	0,2 µm + 0,4·10 ⁻⁶ ./ 0,2 µm + 1,3·10 ⁻⁶ ./	X- en Y-as, 2D en 3D X- en Y-as, 2D en 3D	
		(0 – 100) mm (0 – 250) mm	0,1 µm + 2,8·10 ⁻⁶ ./ 0,2 µm + 2,4·10 ⁻⁶ ./	Z-as Z-as	
	3- D (QV-type): zero-glas Met handmatige thermische compensatie	(0 – 400) mm (0 – 1000) mm	0,2 µm + 0,4·10 ⁻⁶ ./ 0,2 µm + 1,3·10 ⁻⁶ ./	X- en Y-as, 2D en 3D X- en Y-as, 2D en 3D	
		(0 – 100) mm (0 – 250) mm	0,1 µm + 3,4·10 ⁻⁶ ./ 0,2 µm + 3,1·10 ⁻⁶ ./	Z-as Z-as	
	3- D (QV-type): zero-glas Zonder thermische compensatie	(0 – 400) mm (0 – 1000) mm	0,2 µm + 0,4·10 ⁻⁶ ./ 0,2 µm + 9,7·10 ⁻⁶ ./	X- en Y-as, 2D en 3D X- en Y-as, 2D en 3D, met normal glass scale	
		(0 – 100) mm (0 – 250) mm	0,1 µm + 12·10 ⁻⁶ ./ 0,2 µm + 13·10 ⁻⁶ ./	Z-as Z-as	
	haaksheid		15 µm	blokhaak	
	probing error	(0 – 1) µm	44 nm	ISO 10360-7:2011	
	2-D & 3-D (QS- type):	(0 – 200) mm (0 – 400) mm	0,7 µm + 7,5·10 ⁻⁶ ./ 0,7 µm + 8,6·10 ⁻⁶ ./	X- en Y-as X- en Y-as	
		(0 – 100) mm (0 – 250) mm	1,4 µm + 2,6·10 ⁻⁶ ./ 1,4 µm + 2,0·10 ⁻⁶ ./	Z-as Z-as	
	2-D: (QI-type):	(0 – 200) mm (0 – 400) mm	0,7 µm + 7,5·10 ⁻⁶ ./ 0,7 µm + 8,5·10 ⁻⁶ ./	X- en Y-as X- en Y-as	

van **Mitutoyo Nederland B.V.**
Service Department, Calibration Service and Technical Department

Deze bijlage is geldig van: **15-11-2023** tot **01-10-2026**

Vervangt bijlage d.d.: **05-10-2022**

HCS code	Meetgrootheid, Instrument, Maat	Meetbereik	CMC ¹	Opmerkingen	Locatie
	Rondheidsmeters				
	- radiale slag spindle	(0 – 100) nm	10 nm + 2 %·RONt	Rondheidsstandaard met omslag methode, rechtheidsstandaard, haaksheidsstandaard, vlakglas, eindmaten, cilinder, piëzo met laser, liniaal In het geval de detector lineariteit ≤ 1%	
	- axiale slag spindle	(0 – 100) nm	12 nm		
	- rechtheid kolom	(0 – 10) µm	38 nm + 3,5 %·z		
	- rechtheid x-as	(0 – 10) µm	0,14 µm + 1,2 %·z		
	- haaksheid rotatie as/x-as	(0 – 10) µm	0,14 µm + 1,2 %·z		
	- paralleliteit rotatie as/kolom	(0 – 100) µm	0,28 µm + 1,2 %·z		
	- detector lineariteit	(0 – 100) µm	20 nm + 0,2 %·z		
	- detector meetkracht	(0 – 150) mN	2 mN		
	Ruwheidsmeters			Volgens ISO 12179:2000	
	- vlakglas onder een hoek		0,14 µm	Vlakglas, Type A1, Type C1, Type D1 standaarden volgens ISO 5436-1:2000 (hoog nauwkeurige machines met piëzo en laser).	
	- lineariteit x-as		0,06 %·RSm		
	- vertikaal profiel		12 nm+ 2 %·d		
	- ruwheidstandaard type D	(0 – 800) µm			
	Ra-waarde		4,2 nm + 4,2 %·Ra		
	Rz-waarde		42 nm + 2,8 %·Rz		
	- detector		20 nm + 0,2 %·z		
	Contourmeters			Volgens fabrieksnorm	
	- Lineariteit X1-as / Y-as Z2-as	(0 – 200) mm (0 – 600) mm	0,09 µm + 0,29·10 ⁻⁶ ·l 0,11 µm + 0,28·10 ⁻⁶ ·l	Met laserinterferometer	
	- X1-as meetnauwkeurigheid	(0 – 50) mm	0,24 µm + 0,80·10 ⁻⁶ ·l	Met x-as masterobject	
	- X1-as rechtheid	(0 – 200) mm	0,12 µm	Met vlakglas of rei	
	- Z1-as meetnauwkeurigheid	(-30 – 30) mm	0,30 µm + 0,40·10 ⁻⁶ ·l	Met eindmaten en vlakglas	

van **Mitutoyo Nederland B.V.**
Service Department, Calibration Service and Technical Department

Deze bijlage is geldig van: **15-11-2023 tot 01-10-2026**

Vervangt bijlage d.d.: **05-10-2022**

HCS code	Meetgrootheid, Instrument, Maat	Meetbereik	CMC ¹	Opmerkingen	Locatie
	- Z2-as meetnauwkeurigheid	(0 – 600) mm	1,0 µm + 2,4·10 ⁻⁶ ·l	Met stappeneindmaat	
	LSM Laser scan micrometers			Prestatietest met: - pennen / schijven	
	- Lineariteit - Herhaalbaarheid - Positiefout	(0 – 160) mm	0,37 µm + 25·10 ⁻⁶ ·l 0,02 µm 1,1 µm		
	Schuifmaten			Prestatietest	VE
	- E - S - bereik van L	(0 - 2000) mm	0,3 µm + 1.10-5·l 0,5 µm 0,6 µm	Conform ISO 13385-1	
DM 4 0	Diameter			d = gemeten diameter (m)	VE
	Instelringen				
	- diameter	(4 – 50) mm	0,2 µm	laserinterferometer + CMM	
	Referentiekogels				
	- diameter	(0 – 30) mm	0,2 µm	laserinterferometer + CMM	
DM 5 0	Vormfout				VE
	Meetinstrumenten voor vorm				
	- rechtheid reien	(0 – 2) mm	1,5 µm	Met CMM: lengte reien tot 1000 mm	
	- rechtheid reien	(0 – 10) µm	38 nm +3,5 %-z	Met rondheidsmeetmachine: Reien tot 280 mm	
	- rechtheid reien	(0 – 50) µm	36 nm + 0,12·10 ⁻⁶ ·L	Met autocollimator + CMM: Reien tot 700 mm (evt tot 2000 mm)	
	- rechtheid mesreien	(0 – 2) mm	1,5 µm	Met CMM: lengte mesreien tot 1000 mm	

van **Mitutoyo Nederland B.V.**
Service Department, Calibration Service and Technical Department

Deze bijlage is geldig van: **15-11-2023 tot 01-10-2026**

Vervangt bijlage d.d.: **05-10-2022**

HCS code	Meetgrootheid, Instrument, Maat	Meetbereik	CMC ¹	Opmerkingen	Locatie
	Rondheid	d tot 300 mm		Met rondheidsmeetmachine volgens ISO 12181:2011 norm	
	- instelringen (binnen & buiten)	$RONt$: (0 – 12) μ m	40 nm + 2 % · $RONt$	- in het midden	
	- referentiekogels	(0 – 12) μ m	40 nm + 2 % · $RONt$	- op de evenaar	
	- rondheidsstandaarden	(0 – 1) μ m	10 nm + 2 % · $RONt$	- op de evenaar met omslag- of multi step methode	
	- Flick standaard	$2 \mu\text{m} < RONt < 100 \mu\text{m}$	150 nm + 2 % · $RONt$	Met rondheidsmeetmachine	
	- Test cirkels voor ISO 10360-7:2011 (kalibratieplaat)	$RONt$: (0 – 1) μ m	40 nm	Beeldverwerkingsmachine met multi step methode	
	Contour				
	x-as standaard	(0 – 200) mm	$0,24 \mu\text{m} + 0,16 \cdot 10^{-6} \cdot l$	Formtracer SV-C4500	
DM 6 0	Ruwheid				VE
	Oppervlakteruwheid			Met ruwheidsmeter volgens ISO 4287:1997	
	Groefdiepte / staphoogte	(0 – 20) μ m		Formtracer SV-C4500	
	d		10 nm + 2% · d		
	Pt		10 nm + 2% · Pt		
	Ra	(0 – 20) μ m	3 nm + 3% · Ra	Formtracer SV-C4500	
	Rz	(0 – 80) μ m	30 nm + 2% · Rz	Formtracer SV-C4500	
	Rt	(0 – 80) μ m	40 nm + 3% · Rt	Formtracer SV-C4500	
	RSm	10 μ m – 250 μ m	0,1% · RSm	Formtracer SV-C4500	
	RSm	10 μ m – 250 μ m	0,01% · RSm	laserinterferometer + beeldverwerkings-meetmachine	

van **Mitutoyo Nederland B.V.**
Service Department, Calibration Service and Technical Department

Deze bijlage is geldig van: **15-11-2023** tot **01-10-2026**

Vervangt bijlage d.d.: **05-10-2022**

HCS code	Meetgrootheid, Instrument, Maat	Meetbereik	CMC ¹	Opmerkingen	Locatie
DM 8 0	Coördinaten-meetmachines			Prestatietest	OS
	Tastafwijking			Conform ISO 10360-5, met:	
	Afwijkingen enkele taster: P _{Form.Sph.1x25:SS:Tact} P _{Size.Sph.1x25:SS:Tact}	(0 – 51) mm	0,11 µm 0,21 µm	Referentiekogel	
	Afwijkingen scannend: P _{Form.Sph.Scan:PP:Tact} P _{Size.Sph.Scan:PP:Tact}	(0 – 51) mm	0,11 µm 0,21 µm	Referentiekogel	
	High-end CMM's: P _{Size.Sph.1x25:SS:Tact} P _{Size.Sph.Scan:PP:Tact}	(0 – 51) mm	0,10 µm 0,10 µm	High-end Referentiekogel	
	Lengtemeet-afwijkingstest			Conform ISO 10360-2, met	
	Lengtemeet-afwijking E _L (E ₀ en E ₁₅₀)	(0 – 1) m (0 – 1,5) m (0 – 0,15) m	0,24 µm + 0,57·10 ⁻⁶ ./ 0,30 µm + 0,53·10 ⁻⁶ ./ 0,14 µm + 0,43·10 ⁻⁶ ./	Stalen stappeneindmaat	
		(0 – 6) m	0,08 µm + 0,54·10 ⁻⁶ ./	Laserinterferometer + 25 mm eindmaat	
		(0 – 1) m	0,02 µm + 0,29·10 ⁻⁶ ./	Lage uitzetting Zero-keramische eindmaat	
	Repeatability bereik			Conform ISO 10360-2, met	
	R ₀	(0 – 1) m	0,02 µm	Stalen stappeneindmaat	
		(0 – 6) m	0,14·10 ⁻⁶ ./	Laser interferometer + 25 mm eindmaat	
		(0 – 1) m	0,01 µm	Lage uitzetting Zero-keramische eindmaat	

van **Mitutoyo Nederland B.V.**
Service Department, Calibration Service and Technical Department

Deze bijlage is geldig van: **15-11-2023 tot 01-10-2026**

Vervangt bijlage d.d.: **05-10-2022**

HCS code	Meetgrootheid, Instrument, Maat	Meetbereik	CMC ¹	Opmerkingen	Locatie
DM 9 0	Hoek			Met CMM: l = verplaatsing op lange been (m) L = lengte korte been (m)	VE
	Hoekhaak 90° hoekhaken (blokhoekhaken met of zonder aanlegvlak)				
	- hoekafwijking	± 0,5°	(0,5 · m/L)" (≈ 2,4 μm/L)	beenlengte tot (700 x 1000) mm	
	- rechtheid	(0 – 2) mm	1,5 μm	beenlengte tot 700 mm	
	- vormafwijking lange been	± 1 mm	(1,5 + 1,0 · l/L) μm	beenlengte tot (700 x 1000) mm	
TE 0 0	Temperatuur				VE
TE 4 1	Zelf aanwijzende thermometers	(5 – 40) °C	0,03 °C	In temperatuur bad (1)	

Opmerkingen:

De omgevingstemperatuur in de kalibratie laboratoria is nominaal 20 °C.

De "variatie in lengte (v)" of "variation of length" is gedefinieerd in overeenstemming met de ISO 3650:1998 norm.

(1) Secundaire kalibraties in relatie tot geometrische kalibraties (DM).